

слой (*p*-слой); около контакта возникает т. н. физический *p* — *n*-переход.

Для получения стабильных выпрямляющих и инжектирующих контактов в полупроводнике создают специально легированный слой с противоположным объёму типом проводимости (рис. 6). Высокая эмиссионная способность образующегося т. н. металлургич. *p* — *n*-перехода достигается, если дырочный слой легирован акцепторами значительно сильнее, чем объём полупроводника донорами (*p*⁺ — *n*-переход или *n*⁺ — *p*-переход). Инжекция неосновных носителей лежит в основе работы эмиттеров биполярных транзисторов.

Двойная инжекция (одновременная инжекция с двух сторон дырок и электронов) происходит в образцах полупроводника, ограниченных с одной стороны *p*⁺ — *n*-контактом, а с другой *n*⁺ — *p*-контактом (*p*⁺ — *nn*⁺-диоды или *p*⁺ — *pn*⁺-диоды). Рост концентрации электронов и дырок в средней части образцов ограничен только скоростью рекомбинации носителей. Инжекция, ограниченная рекомбинацией, более эффективна, чем инжекция, ограниченная пространственным зарядом.

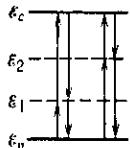
Реальные контакты. Инжекция и экстракция неосновных носителей контактом с обеднённым слоем эффективны лишь в случае, когда контакт не является дополнит. источником рекомбинации или генерации носителей, т. е. если потоки носителей каждого типа переносятся через обеднённый слой без «потерь» и «приобретений». Последние обусловлены тремя причинами.

1) Неверхностная рекомбинация и генерация через центры, локализованные на границе металла — полупроводник или диэлектрич. прослойка — полупроводник. Это же происходит в тонкой приконтактной области, где концентрация центров рекомбинации существенно выше, чем в объёме полупроводника, из-за дефектной структуры этой области и из-за диффузии сюда примесей из металла или окисла.

2) Скорость термич. генерации и рекомбинации носителей в обеднённом слое через глубокие уровни (расположенные вблизи середины запрещённой зоны) выше по сравнению с теми же процессами в объёме полупроводника (механизм Са — Нойса — Шокли). Напр., отношение скоростей термич. генерации в обеднённом слое и объёме порядка $Wn/2ln_i T$, где *n* — концентрация основных носителей, *W* — толщина слоя, *l* — длина диффузии носителей, *n_i* — концентрация собственных носителей. В Ge, Si и др. полупроводниках, как правило, $W < l$, но в легированных полупроводниках $n \gg n_i$, что делает этот механизм существенным.

3) ТунNELьная (полевая) генерация и рекомбинация носителей в обеднённых слоях. В отличие от объёма полупроводника, где возможны только вертикальные

Рис. 7. Рекомбинационные и генерационные переходы электронов в нейтральном объёме полупроводника: ϵ_c — край зоны проводимости; ϵ_v — край валентной зоны; ϵ_1 , ϵ_2 — комбинационные уровни.

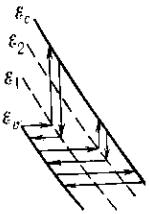


переходы между рекомбинационными уровнями ϵ_1 , ϵ_2 в запрещённой зоне и состояниями в разрешённых зонах, сопровождающиеся поглощением энергии при генерации и её выделении при рекомбинации (рис. 7), в обеднённых слоях виду изгиба зон возможны горизонтальные переходы (рис. 8). Они обусловлены туннелированием из состояний в разрешённых зонах на уровне рекомбинационных центров или даже непосредственно между валентной зоной и зоной проводимости (межзонное, или зиннеровское, туннелирование). С участием рекомбинационных центров возможен комбинированный процесс, включающий горизонтальные и вертикальные переходы. При этом полное энерговыде-

ление или энергопоглощение на одну пару электрон-дырка меньше ширины запрещённой зоны E_g .

Высокий темп генерации и рекомбинации носителей в обеднённом слое ухудшает выпрямляющие и инжекционные свойства такого контакта. При обратном смещении он становится источником генерации неравновесных носителей, а прямом смещении — источником их рекомбинации. Для контактов с очень высокой скоростью рекомбинации также применяется термин «омический», подразумевая контакт, на к-ром при любых *j* поддерживается равновесные значения концентрации носителей. Инжекционные

Рис. 8. Туннельные и комбинированные переходы в областях с наклоном энергетических зон.



свойства таких контактов проявляются лишь при очень больших *j*, тем больших, чем выше скорость рекомбинации в нём.

Лит.: Пикус Г. Е., Основы теории полупроводниковых приборов, М., 1965; Бонч-Бруевич В. Л., Калашников С. Г., Физика полупроводников, М., 1977; Стриха В. И., Контактные явления в полупроводниках, К., 1982; Родерик Э. Х., Контакты металла — полупроводник, пер. с англ., М., 1982.

З. С. Грибников.

КОНТИНУАЛЬНЫЙ ИНТЕГРАЛ — то же, что функциональный интеграл.

КОНТРАВАРИАНТНОСТЬ — см. в ст. Ковариантность и контравариантность.

КОНТРАГИРОВАННЫЙ РАЗРЯД (от лат. *contraho* — стягиваю, сжимаю) — электрический разряд в газе, диаметр столба к-рого существенно уменьшен по сравнению с тем же разрядом при меньших силах тока. При контракции (самосжатии) разряда в неск. раз возрастает объёмная плотность энергии в плазме столба и поэтому резко увеличивается общая яркость свечения и изменяется его спектральный состав. Контракция происходит вследствие к-л. качественного изменения условий энергетич. баланса с ростом силы тока в радиально неоднородном столбе плазмы. В плазме молекулярных газов, напр., это изменение возникает вследствие резкого увеличения скорости переноса тепла при приближении степени диссоциации к полной. В атомарных газах при значительно больших токах (десяти или сотни кА) условия баланса резко меняются и возникает контракция, когда собственноемагн. давление становится больше газокинетического (см. Пинч-эффект). Чем выше давление газа, тем при меньших токах может произойти переход к К. р. Сжатие столба за счёт действия внеш. причин (стенок, внеш. полей) не наз. контракцией.

В. Н. Колесников.

КОНТРАКЦИЯ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА (сжатие газового разряда) — резкое, скачкообразное уменьшение попечерного размера области, заполненной разрядным током, возникающее при превышении нек-рого критич. значения давления газа или разрядного тока. При К. г. р. в неск. раз возрастает объёмная плотность энергии в плазме столба и поэтому резко увеличивается общая яркость свечения и изменяется его спектральный состав. Это явление, характерное для всех типов газового разряда, ограничивает возможность практического использования газоразрядных устройств областью относительно малых давлений и разрядных токов.

К. г. р. происходит при одновременном выполнении двух условий: 1) эффективность образования заряж. частиц резко спадает от оси к стенкам разрядной трубки; 2) характерное время объёмной рекомбинации (нейтрализации) заряж. частиц $(\alpha_{rek} N)^{-1}$ много меньше времени их диффузии на стенки разрядной трубы R_0^2/D_a (здесь *N* — плотность заряж. частиц в разряде, α_{rek} — коф. объёмной рекомбинации заряж. частиц, *R₀* — радиус разрядной трубы, *D_a* — коф. амбиополярной диффузии). За время рекомбинации заряж. час-